

# デモラインご活用ください スパッタリング装置

Model : SRH-420

## ◆実装、パワーに最適な量産向けモデル 高精度、高信頼性の接続層を形成

### 特徴

- 2010年製装置をリファービッシュ
- プロセス室 マルチ×2室仕様
- 各サイズESC (4",6",8")準備
- 水冷・加熱ステージ
- 磁性・非磁性成膜に対応



### 膜種

	元素記号
単金属	Ag、Al、Au、Cu、Mo、Ni、Ti

※基板とターゲットは御支給ください

### 構成

項目	構成
Type	ロードロック式 スパッタダウン
チャンバー構成	E2 : ISM エッチング M3 : 磁性用スパッタ (非磁性も可) M4 : 非磁性用スパッタ
Process P/S	E2 : Antenna 1kW / Bias 0.6kW M3 : DC10kW M4 : DC10kW
Stage仕様	E2 : 水冷+ESC M3 : 水冷+ESC ※T/S 2段設定 M4 : ESC-H.P MAX350°C
T/S距離(mm)	M3 : 磁性67/57 非磁性60/50 M4 : 60
ガス系統	Ar50sccm
対応基板	4,6,8inch オリフラ (SiC対応)
真空ポンプ	E2 : TMP+CT M3 : CP M4 : CP

### ご相談ください

- 成膜試作、検証
- 現象解析
- 操作性確認
- 中古機導入検討

ご相談はアルバックテクノへ



SRH-420\_1.5

# ULVAC